文章编号:1007-2934(2010)03-0001-03

ZnO 纳米薄膜的电化学制备及其 AFM 形貌表征

袁 博,夏 惠,王晓雄,徐永祥,李相银 (南京理工大学,江苏南京 210094)

摘 要:利用恒电位电化学沉积方法在 ITO 导电玻璃基底上制备了纳米 ZnO 薄膜,并利用原子力显微镜进行了形貌表征。结果显示,当沉积电压为-0.8 V 时,经过 30 min 的沉积在基底上形成了由规则排列的三角形 ZnO 晶粒构成的纳米薄膜。对晶粒的形成机理进行了初步的讨论。

关 键 词: 电化学沉积; ZnO 纳米薄膜; 原子力显微镜; 形貌 中图分类号: O 484.1 **文献标识码**: A

ZnO 是一种直接带隙宽禁带半导体材料,在 信息领域有着重要的应用^[1]。和目前广泛使用的 光电子材料 GaN 相比,ZnO 薄膜具有生长温度 低、激子束缚能高(60 meV)^[2]等优点,理论上在 室温下能够实现较强的紫外受激发射,可用来制 作各种发光二极管、短波长激光器^[3]、发光显示器 件、高速光开关和紫外光电探测器^[4]等光电器件, 吸引了国内外众多学者的研究兴趣。

纳米形态的 ZnO 薄膜,如纳米棒、纳米管、纳 米片等特殊形态 ZnO 纳米粒子构成的氧化锌薄 膜,由于纳米材料特有的量子尺寸效应、小尺寸效 应、表面效应等使其表现出与块体材料很不相同 的光、电、磁性质,而且通过形貌(如晶粒大小、晶 粒形貌等)的控制能有效地调节材料的光电性质, 因此通过制备条件的控制来制备特定形貌的 ZnO 纳米粒子构成的薄膜激起了人们的极大研 究热情。制备 ZnO 纳米薄膜的方法通常有金属 有机物气相沉积(MOCVD)、溶胶凝胶法、磁控溅 射、电化学沉积^[5]等。其中电化学沉积法由于具 有成膜质量高、可以实现原子级掺杂、设备相对简 单、不需要超高真空的优势而得到了特别的关注。 关于电化学沉积制备 ZnO 薄膜的研究已有很多 报道.但是由于电化学沉积过程中溶液的 p H 值、 温度、浓度、沉积电压^[5]等都会对生成的 ZnO 纳 米粒子形貌产生微妙的影响,所以本文利用恒电 位电化学沉积法进行了 ZnO 纳米薄膜的制备,并 且得到了一种有规则排列的三角形晶粒构成的 ZnO 纳米薄膜。

1 实 验

本工作中制备纳米 ZnO 薄膜采用的基片是 ITO 导电玻璃,面电阻 10 ,有效尺寸约为 1 cm x1.5 cm。基底首先经过去离子水超声清洗,然 后在 1 mol/L 的 NaOH 溶液中超声清洗 15 min 以去除污渍。溶液选用的是 0.1 mol/L 的 Zn (NO₃)₂ 溶液。为了抑制 Zn(NO₃)₂ 水解生成难 溶的 Zn(OH)2 絮状沉淀,在电解液中加入了适 量的盐酸。电化学沉积采用的是上海辰华仪器公 司的 CHI660C 型电化学工作站。采用三电极恒 电位方式,对电极选用 2 mm 直径的 Pt 微盘电 极,参考电极选用 Ag/ AgCl 电极。实验过程中记 录电流随时间的变化关系,沉积过程中溶液温度 保持在室温。待样品沉积完毕后,将基片取出,用 去离子水冲洗干净,并利用红外灯烘干,以便进一 步的 AFM 形貌测量。样品的形貌检测利用 CSPM4000型原子力显微镜完成,采用的是接触 式测量。

2 结果分析

为了确定电化学沉积后确实得到了 ZnO 薄膜,而不是基底上的铟锡氧化物(ITO)薄膜,首先利用 AFM 测量了基底的形貌。图 1(a)、(b)是经 去离子水清洗和经 NaOH 清洗的 ITO 玻璃基底 的形貌图,扫描范围都是 2 µm ×2 µm。从图中可

收稿日期: 2009-06-27

以看出,经过 NaOH 溶液超声清洗后,基底上大量的小晶粒消失,基底相对变得匀称平整。因此在实验中均采用了经过 NaOH 溶液清洗的 ITO 玻璃作为基片。



图 1 (a) 只用去离子水超声清洗的 ITO 玻璃的 AFM 形貌图 (b) 经 NaOH 溶液超声清洗的 ITO 基片的 AFM 形貌图



图 2 恒压法制备样品的电流-时间曲线图

样品制备采用了恒电位电化学沉积法,沉积 偏压^{-0.8}V(工作电极相对于参考电极的电压), 沉积过程中的电流-时间曲线如图 2 所示。从图 中可以看出电流基本维持在 8 ×10⁻³ A 量级,因 此沉积电流密度约为 5.3 ×10⁻³ A/cm²。过程中 之所以出现电流为零的状态,主要是电解过程中 在 Pt 电极上产生 O_2 聚集,导致电极表面被气泡 包围,从而使导电能力急剧下降,电流瞬时降为 零。当采用的金属盐是 Zn(NO₃)₂ 时,电解过程 中阴极发生如下的反应:

 $Zn(NO_3)_2 Zn_2 + 2NO_3$ (1)

 $NO_{3} + H_{2}O + 2e NO_{2} + 2OH^{-1}$ (2)

 $Zn^{2+} + 2OH Zn(OH)_2$ (3)

$$Zn(OH)_2 \quad ZnO + H_2O \tag{4}$$

图 3 是经过 30 min 沉积后获得的 ZnO 薄膜 的 AFM 形貌图。从图中可以看出 ZnO 纳米粒 子外形规则,均呈现出三角形形状,尺寸较为均 一,而且三角形取向表现出高度的有序性。为了 分析这些三角形的相互位置关系,绘制了L1~L9 九条辅助直线,其中L1~L3、L4~L6、L7~L9 每 组直线各自平行,至此可以明显的看出A、B、C三 个三角形的空间取向关系,它们虽然形貌不是非 常规整,但它们的取向却表现出高度的一致性。 由于所用的基底是镀有 180 nm ITO 薄膜的石英 基片,其中 ITO 薄膜是无序的,正如前面基片预 扫描的结果所示,因此得到的 ZnO 三角形纳米片 的取向不应该归因于 ITO 薄膜的模板作用。同 时,由于 ZnO 通常情况下为六角纤锌矿结构,它 的(0001)晶面具有最小的表面能,因此通常会沿 着(0001)方向择优生长,所以通常得到的 ZnO 纳 米粒子通常呈现出六角形[6],而非试验中观察到 的三角形,这是一个有待进一步深入研究的有趣 课题。通过它的生长机制的研究,无疑为可控地 生长这种结构提供了可行途径。



图 3 所得样品的 AFM 形貌图

通过分析还可以看出,这些三角形的 ZnO 纳 米片似乎是预先在溶液中生长成纳米片,然后再 有序地铺到基底上似的。在图 4 中用直线勾画出 了三个三角形的轮廓。显然三角形 B 左右上角 分别位于三角形 A 和 C 的下方。为了更好的阐 明这三个三角形的位置关系,绘制了剖面线 L ,其 位置如图 4(a) 所示,沿剖面线 L 的样品表面的高 低起伏如图 4(b) 所示。从剖面线中还可以看出, 上角形 A、C 位于 B 的上方。这些三角形纳米片 的厚度也比较一致,A、C 的厚度分别为 5.88 nm 和 6.56 nm,比较接近。



(a)为第一次实验所得样品的 AFM 形貌图,三角形 A、B、C 勾 勒出了三个三角形的轮廓。(b)沿剖面线 L 的样品的表面形 貌起伏

图 4 表面形貌剖面图

3 结束语

本文利用恒压电化学方法制备了由具有规则三 角形形状晶粒构成的纳米 ZnO 薄膜,利用 AFM 对 其形貌进行了初步的分析,并初步讨论了可能的形 成机理,进一步的研究将为可控地制备特定形貌、特 定光电性质的 ZnO 薄膜提供基础。

参考文献:

- L. Schmidt-Mende, J. L. Macmanus-Driscoll. ZnOnanostructures Defects and Devices [J]. Materials Today,2007(10):40.
- [2] T. Pauport ,D. Lincot ,B. Viana ,et al. Toward Laser Emission of Epitaxial Nanorod Arrays of ZnO Grown by Electrode Position [J]. Applied Physics Letters ,2006 (89) :233112.
- [3] L. K. Teh, C. C. Wong, H. Y. Yang, et al. Lasing in Electrodeposited ZnO Inverse Opal[J]. Appl. Phys. Lett, 2008 (91) :16111.
- [4] J. Chen, L. A, C. Aichele, et al. High Internal Quantum Efficiency ZnO Nanorods Prepared at Low Temperature [J]. 2008 (92) :161906.
- [5] G. W. She, X. H. Zhang, W. S. Shi, et al. Controlled Synthesis of Oriented Single-crystal ZnO Nanotube Arrays on Transparent Conductive Substrates [J]. Appl. Phys. Lett, 2008 (92) :053111.
- [6] T. Pauport, D. Lincot. Heteroepitaxial Electrodeposition of Zinc Oxide Lms on Gallium Nitride[J]. Applied Physis Letters, 1999(75):3817.

Preparation of ZnO Nanofilm with Electrodeposition and AFM Characterization

YUAN Bo ,XIA Hui ,WANG Xiao-xiong ,XU Yong-xiang ,LI Xiang-yin

(Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094)

Abstract : The ZnO nanofilm was prepared on the ITO substrate with electrodeposition, and the morphology of the film was characterized by AFM. The results indicate that when the bias was -0.8 V, we could obtain the ZnO nano film composed of triangle-shaped ZnO crystal grains after 30min deposition. A brief discussion on the mechanism of the film growth was provided.

Key words: electrodeposition; ZnO nanofilm; AFM; characterize